Docket No. 248442US0

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

IN RE APPLICATION OF: Toshiya SAGISAKA, et al.		GAU:
SERIAL NO	:NEW APPLICATION	EXAMINER:
FILED:	HEREWITH	
FOR:	NEW ARYL AMINE POLYMER, THIN FILM TRAPOLYMER, AND METHOD OF MANUFACTURE	ANSISTOR USING THE NEW ARYL AMINE NG THE THIN FILM TRANSISTOR
	REQUEST FOR P	
	ONER FOR PATENTS RIA, VIRGINIA 22313	
SIR:	,	
☐ Full ben	efit of the filing date of U.S. Application Serial Numbers of 35 U.S.C. §120.	er , filed , is claimed pursuant to the
☐ Full bene §119(e):		n(s) is claimed pursuant to the provisions of 35 U.S.C. <u>Date Filed</u>
	nts claim any right to priority from any earlier filed appisions of 35 U.S.C. §119, as noted below.	plications to which they may be entitled pursuant to
In the matter	of the above-identified application for patent, notice i	s hereby given that the applicants claim as priority:
COUNTRY Japan	<u>APPLICATION NUMB</u> 2003-035582	ER MONTH/DAY/YEAR February 13, 2003
Japan	2003-307561	August 29, 2003
Japan	2003-185402	June 27, 2003
Japan	2003-373723	October 31, 2003
Japan	2004-24866	January 30, 2004
Japan	2004-24867	January 30, 2004
Japan	2004-24878	January 30, 2004
Japan	2004-27234	February 3, 2004
JP 20	pies of the corresponding Convention Application(s) 003-035582, 2003-307561, 2003-373723 are submitted the result of the Final Fee be submitted prior to payment of the Final Fee	I herewith, all others will be submitted prior to
□ were	filed in prior application Serial No. filed	
were submitted to the International Bureau in PCT Application Number Receipt of the certified copies by the International Bureau in a timely manner under PCT Rule 17.1(a) has been acknowledged as evidenced by the attached PCT/IB/304.		
\Box (A) A	Application Serial No.(s) were filed in prior application	n Serial No. filed ; and
□ (B) A	Application Serial No.(s)	
	Respectfully Submitted,	
		OBLON, SPIVAK, McCLELLAND, MAIER & NEUSTADT, P.C.
Customor	Number	J. Derek Mason, Ph.D.
Customer Number		Registration No. 35,270

22850

Tel. (703) 413-3000 Fax. (703) 413-2220 (OSMMN 05/03)

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application:

2003年 6月27日

出 願 番 号 Application Number:

特願2003-185402

[ST. 10/C]:

[JP2003-185402]

出 願 人
Applicant(s):

株式会社リコー

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2003年11月13日

今井康



【書類名】

特許願

【整理番号】

0302350

【提出日】

平成15年 6月27日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

COSG 61/12

【発明の名称】

新規なアリールアミン重合体

【請求項の数】

【発明者】

【住所又は居所】

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内

【氏名】

匂坂 俊也

【発明者】

【住所又は居所】

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内

【氏名】

佐々木 正臣

【発明者】

【住所又は居所】

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内

【氏名】

息居 昌史

【発明者】

【住所又は居所】

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内

【氏名】

河村 慎一

【発明者】

【住所又は居所】

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内

【氏名】

岡田 崇

【特許出願人】

【識別番号】

000006747

【氏名又は名称】 株式会社リコー

【代表者】

桜井 正光

【代理人】

【識別番号】

100074505

【弁理士】

【氏名又は名称】

池浦 敏明

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

009036

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9909722

【プルーフの要否】

要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 新規なアリールアミン重合体

【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記一般式(I)で表される繰り返し単位を含有する重合体

【化1】

$$\begin{array}{c}
(R^{2})_{y} \\
(R^{3})_{z}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
(R^{3})_{z} \\
CH = CH
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
(I)
\end{array}$$

(式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 はそれぞれ独立にハロゲン原子、置換もしくは無置換で直鎖または分岐鎖の、アルキル基またはアルコキシ基もしくはアルキルチオ基から選択される基を表し、x、y、zはそれぞれ独立に0から4の整数を表し、 R^1 、 R^2 、 R^3 が各々複数存在する場合には、同一でも別異でもよく、Arは置換もしくは無置換の芳香族炭化水素基を表す。)

【請求項2】 下記一般式(II)で表される繰り返し構成単位を含有する重合体。

【化2】

$$(R^{2})_{y} \qquad (R^{3})_{z}$$

$$(R^{1})_{x} \qquad (R^{4})_{w} \qquad (II)$$

(式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 はそれぞれ独立にハロゲン原子、置換もしくは無置換で直鎖または分岐鎖の、アルキル基またはアルコキシ基もしくはアルキルチオ基から選択される基を表し、wは0から5の整数を示し、x、y、zはそれぞれ独立に0から4の整数を表し、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 が各々複数存在する場合には、同一でも別異でもよい。)

【請求項3】 下記一般式 (III) で表される繰り返し単位を含有する重合

体。

【化3】

$$(R^{2})_{y} \qquad (R^{3})_{z}$$

$$(R^{1})_{x} \qquad (R^{5})_{v} \qquad (III)$$

$$(R^{6})_{u}$$

(式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^5 、 R^6 はそれぞれ独立にハロゲン原子、置換もしくは無置換で直鎖または分岐鎖の、アルキル基またはアルコキシ基もしくはアルキルチオ基から選択される基を表し、uは0から5の整数を示し、v、x、y、zはそれぞれ独立に0から4の整数を表し、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^5 、 R^6 が各々複数存在する場合には、同一でも別異でもよい。)

【請求項4】 下記一般式(IV)で表される繰り返し単位を含有する重合体

【化4】

$$(R^{2})_{y}$$
 $(R^{3})_{z}$

$$(R^{1})_{x}$$
 $(R^{7})_{t}$

$$(R^{8})_{s}$$

$$(R^{8})_{s}$$

(式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^7 、 R^8 はそれぞれ独立にハロゲン原子、置換もしくは無置換で直鎖または分岐鎖の、アルキル基またはアルコキシ基もしくはアルキルチオ基から選択される基を表し、t は 0 から 3 の整数を示し、s、x、y、z はそれぞれ独立に 0 から 4 の整数を表し、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^7 、 R^8 が各々複数存在する場合には、同一でも別異でもよい。)

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は新規なアリールアミン重合体に関し、さらに詳しくは有機EL素子用 材料、有機トランジスタ用材料等として有用な新規なアリールアミン重合体に関 する。

[0002]

【従来の技術】

有機材料の発光特性や電荷輸送特性を利用して、有機エレクトロルミネッセンス素子や、有機トランジスタ素子が提案されている。これらの素子に有機材料を用いることにより、軽量、安価、低製造コスト、フレキシブル等の利点が期待される。

[0003]

有機薄膜EL素子用の材料としては、低分子系および高分子系の様々な材料が 報告されている。低分子系においては、種々の積層構造の採用により高効率化の 実現が、またドーピング法をうまくコントロールすることにより耐久性の向上が 報告されている。しかし、低分子集合体の場合には、長時間における経時での膜 状態の変化が生じることが報告されており、膜の安定性に関して本質的な問題点 を抱えている。一方、高分子系材料においては、これまで、主にPPV(pol y-p-phenylenevinylene) 系列やpoly-thioph e n e 等のπ共役系高分子について精力的に検討が行われてきた。しかしながら 、これらの材料系は純度を上げることが困難であることや、本質的に蛍光量子収 率が低いことが問題点として挙げられ、高性能なEL素子は得られていないのが 現状である。またπ共役高分子主鎖中にアリールアミン部位を含む高分子材料も 検討されている(特開平10-310635号公報…特許文献1、特開平8-1 5 7 5 7 5 号公報···特許文献 2 、特表 2 0 0 2 - 5 1 5 0 7 8 号公報およびW O 97/09394、Synth. Met., 84, 269, 1997)。高分子 材料は本質的にガラス状態が安定であることを考慮すると、高蛍光量子効率を付 与することができれば優れたEL素子の構築が可能となるため、この分野でさら なる改良が行われている。

[0004]

一方、有機薄膜トランジスタ素子においても、低分子系および高分子系の様々な材料が報告されている。例えば低分子材料ではペンタセン(Synth. Met.,51,419,1992)、フタロシアニン(Appl. Phys. Lett.,69,3066,1996.)、フラーレン(特開平8-228034号公報…特許文献3、Appl. Phys. Lett.,67,121,1995.)、アントラジチオフェン(特開平11-195790号公報・・・特許文献4)、チオフェンオリゴマー(特許第3145294号公報、Chem. Mater.,4,457,1998.)、ビスジチエノチオフェン(Appl. Phys. Lett.,71,3871,1997.)などが、また高分子材料ではポリチオフェン(Appl. Phys. Lett.,69,4108,1996.)、ポリチエニレンビニレン(Appl. Phys. Lett.,63,1372,1993.)などの幾つかの材料が挙げられる。

[0005]

しかし、上記の材料においても、低分子系では膜の安定性に関する問題が、高 分子系では純度に起因する低性能の問題があり、さらなる改良が望まれている。

[0006]

【特許文献1】

特開平10-310635号公報

【特許文献2】

特開平8-157575号公報

【特許文献3】

特開平8-228034号公報

【特許文献4】

特開平11-195790号公報

[0007]

【発明が解決しようとする課題】

本発明は上記従来技術の現状に鑑みてなされたものであり、優れた発光特性を 有すると共に耐久性に優れた有機薄膜EL素子用の高分子材料として、また有機 トランジスタの活性層用高分子材料として有用な新規アリールアミン重合体を提供することを目的とする。

[0008]

【課題を解決するための手段】

本発明者らは鋭意検討した結果、特定の構成単位を含有する新規アリールアミン重合体により上記課題が解決されることを見出し、本発明に至った。

即ち、本発明によれば、以下の(1)~(4)が提供される。

(1) 下記一般式(I) で表される繰り返し単位を含有する重合体。

【化5】

$$\begin{array}{c}
(R^2)_y \\
(R^3)_z
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
(R^3)_z \\
CH = CH
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
(R^3)_z \\
CH = CH
\end{array}$$

(式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 はそれぞれ独立にハロゲン原子、置換もしくは無置換で直鎖または分岐鎖の、アルキル基またはアルコキシ基もしくはアルキルチオ基から選択される基を表し、x、y、zはそれぞれ独立に0から4の整数を表し、 R^1 、 R^2 、 R^3 が各々複数存在する場合には、同一でも別異でもよく、Arは置換または無置換の芳香族炭化水素基を表す。)

(2) 下記一般式(II) で表される繰り返し単位を含有する重合体。

【化6】

$$(R^2)_y$$
 $(R^3)_z$ $(R^1)_x$ $(R^4)_w$ $(R^4)_w$

(式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 はそれぞれ独立にハロゲン原子、置換もしくは無置換で直鎖または分岐鎖の、アルキル基またはアルコキシ基もしくはアルキルチオ基から選択される基を表し、wは0から5の整数を示し、x、y、zはそれぞれ独立に0から4の整数を表し、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 が各々複数存在する

場合には、同一でも別異でもよい。)

(3) 下記一般式(III) で表される繰り返し単位を含有する重合体。

【化7】

$$(R^2)_y$$
 $(R^3)_z$
 $(R^1)_x$
 $(R^5)_y$
 $(R^5)_y$
 $(R^6)_u$
 $(R^6)_u$

(式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^5 、 R^6 はそれぞれ独立にハロゲン原子、置換もしくは無置換で直鎖または分岐鎖の、アルキル基またはアルコキシ基もしくはアルキルチオ基から選択される基を表し、uは0から5の整数を示し、v、x、y、zはそれぞれ独立に0から4の整数を表し、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^5 、 R^6 が各々複数存在する場合には、同一でも別異でもよい。)

(4) 下記一般式(IV)で表される繰り返し単位を含有する重合体。

【化8】

$$(R^{2})_{y} \qquad (R^{3})_{z}$$

$$(R^{1})_{x} \qquad (R^{7})_{t} \qquad (IV)$$

(式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^7 、 R^8 はそれぞれ独立にハロゲン原子、置換もしくは無置換で直鎖または分岐鎖の、アルキル基またはアルコキシ基もしくはアルキルチオ基から選択される基を表し、t は0から3の整数を示し、s、x、y、z はそれぞれ独立に0から4の整数を表し、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^7 、 R^8 が各々複数存在する場合には、同一でも別異でもよい。)

[0009]

【発明の実施の形態】

上記の本発明のアリールアミン重合体は有機トランジスタ用の電荷輸送性高分子材料として、また優れた発光特性を有すると共に耐久性に優れた有機薄膜EL素子用の高分子材料として有用である。

[0010]

以下に本発明のアリールアミン重合体の製造法について説明する。

本発明のアリールアミン重合体の製造方法は、例えばアルデヒドとホスホネートを用いたWittigーHorner反応、アルデヒドとホスホニウム塩を用いたWittig反応、ビニル置換体とハロゲン化物を用いたHeck反応、アミンとハロゲン化物を用いたUllmann反応などを用いることができ、公知の方法により製造可能である。特にWittigーHorner反応およびWittig反応は反応操作の簡便さから有効である。

$[0\ 0\ 1\ 1]$

一例としてWitig-Horner反応を用いた本発明における重合体の製造方法について説明する。

本発明における重合体は、下記の反応式で示されるように、ホスホン酸エステル化合物およびアルデヒド化合物が化学量論的に等しく存在する溶液と、その2倍モル量以上の塩基を混合させることにより重合反応が進行し得ることができる

[1k9]

本発明のアリールアミン重合体を製造する場合には、例えば、Aとしてアリールアミン部位、Bとしてフェニル部位の組み合わせのモノマーを用いるか、またはAとしてフェニル部位、Bとしてアリールアミン部位の組み合わせのモノマーを用いるか、A、Bともにフェニルビニレン置換アリールアミンのモノマーを用いればよい。

[0012]

また、複数種のホスホン酸エステル化合物あるいはアルデヒド化合物を反応系

内に添加することにより、ランダム共重合体を得ることもでき、諸特性を調整することも可能である。

上記反応に使用する塩基はホスホネートカルボアニオンが形成されるものであれば特に限定されず、金属アルコシド、金属ヒドリド、有機リチウム化合物等が挙げられ、例えばカリウム t ーブトキシド、ナトリウム t ーブトキシド、リチウム t ーブトキシド、カリウム 2 ーメチルー 2 ーブトキシド、カリウム 2 ーメチルー 2 ーブトキシド、カリウム 2 ーメチルー 2 ーブトキシド、ナトリウムエトキシド、カリウムエトキシド、カリウムエトキシド、カリウムエトキシド、カリウム、メチルリチウム、エチルリチウム、プロピルリチウム、1 ーブチルリチウム、1 ーブチルリチウム、1 ーブチルリチウム、1 ーブチルリチウム、1 チウムアミド、リチウムジイソプロピルアミド等を挙げることができる。

反応に用いる塩基の量は、通常ホスホン酸エステル化合物の重合活性点に対して同量使用するだけでよいが、さらに過剰量用いても支障ない。

[0013]

上記の塩基は固形状態や懸濁溶液の状態で反応系内に添加してもよいが、得られる重合体の均質性が良好になる為に、特に均一溶液として添加する事が好ましい。塩基を溶解する溶媒としては、使用する塩基と安定な溶液を形成する溶媒を選択しなければならないが、その他の要因として塩基の溶解度が高いものがよく、また反応系で生成する高分子量体の反応溶媒に対する溶解性を損ねないものがよく、さらに生成する高分子量体が良好に溶解する溶媒がよく、用いる塩基と製造する高分子量体の特性に応じて、一般に知られているアルコール系、エーテル系、アミン系、炭化水素系溶媒等から任意に選択することができる。

[0014]

塩基とそれを均一に溶解する溶媒の組み合わせとしては、例えばナトリウムメトキシドのメタノール溶液、ナトリウムエトキシドのエタノール溶液、カリウム t ーブトキシドの2ープロパノール溶液、カリウム t ーブトキシドの2ーメチルー2ープロパノール溶液、カリウム t ーブトキシドのテトラヒドロフラン溶液、カリウム t ーブトキシドのジオキサン溶液、 n ーブチルリチウムのヘキサン溶液、メチルリチウムのエーテル溶液、リチウム t ーブトキシドのテトラヒドロフラ

ン溶液、リチウムジイソプロピルアミドのシクロヘキサン溶液、カリウムビストリメチルシリルアミドのトルエン溶液等をはじめとして、種々の組み合わせの溶液が挙げられ、幾つかの溶液は市販品として容易に入手することができる。温和な反応条件、取り扱いの容易さの観点から好ましくは金属アルコキシド系の溶液が用いられ、生成する重合体の溶解性、取り扱いの容易さ、反応の効率性、生成する重合体の溶解性等の観点からより、好ましくは金属 t ーブトキシドのエーテル系が用いられ、さらに好ましくはカリウム t ーブトキシドのテトラヒドロフラン溶液が用いられる。

[0015]

上記重合反応はホスホン酸エステル化合物およびアルデヒド化合物の溶液に塩 基溶液を添加してもよく、塩基溶液にホスホン酸エステル化合物およびアルデヒ ド化合物の溶液を加えてもよく、同時に反応系に加えてもよく、添加の順序に制 約はない。

上記重合反応における重合時間は、用いられるモノマーの反応性、または望まれる重合体の分子量等に応じて適宜設定すればよいが、0.2時間~30時間が好適である。

上記重合反応における反応温度は特に制御する必要なく室温において良好に重合反応が進行するが、反応効率をより上げるために加熱したり、またはより温和な条件に冷却することも可能である。

$[0\ 0\ 1\ 6]$

また、以上の重合操作において分子量を調節するために分子量調節剤、または 末端修飾基として重合体の末端を封止するための封止剤を反応途中または反応後 に添加することも可能であり、反応開始時に添加しておくことも可能である。従 って、本発明におけるアリールアミン重合体の末端には停止剤に基づく置換基が 結合してもよい。

分子量調節剤、末端封止剤としては、ベンジルホスホン酸ジエチル、ベンズアルデヒド等のホスホン酸エステル基やアルデヒド基を1個有する化合物が挙げられる。

[0017]

本発明の重合体の好ましい分子量はポリスチレン換算数平均分子量で1000~100000であり、より好ましくは2000~500000である。分子量が小さすぎる場合にはクラックの発生等成膜性が悪化し実用性に乏しくなる。また分子量が大きすぎる場合には、一般の有機溶媒への溶解性が悪くなり、溶液の粘度が高くなって塗工が困難になり、やはり実用性上問題になる。

また、機械的特性を改良するために重合時に分岐化剤を少量加えることもできる。使用される分岐化剤は、重合反応活性基を3つ以上(同種でも異種でもよい)有する化合物である。これらの分岐化剤は単独で使用してもよく、また複数併用してもよい。

[0018]

以上のようにして得られたアリールアミン重合体は、重合に使用した塩基、未 反応モノマー、末端停止剤、又、重合中に発生した無機塩等の不純物を除去して 使用される。これら精製操作は再沈澱、抽出、ソックスレー抽出、限外濾過、透 析等をはじめとする従来公知の方法を使用できる。

[0019]

上記製造方法により得られた本発明の重合体は、スピンコート法、キャスト法、ディップ法、インクジェット法、ドクターブレード法、スクリーン印刷法等の公知の成膜方法により、クラックのない強度、靭性、耐久性等に優れた良好な薄膜を作製することが可能であり、有機EL素子、有機トランジスタ素子などの材料として好適に用いることが可能である。

[0020]

次に本発明の重合体の繰り返し単位(I) \sim (IV) についてさらに詳細に説明する。

前記一般式(I)における置換もしくは無置換の芳香族炭化水素基としては単環基、多環基(縮合多環基、非縮合多環基)の何れでもよく、一例として以下のものを挙げることができる。例えばフェニル基、ナフチル基、ピレニル基、フルオレニル基、アズレニル基、アントリル基、トリフェニレニル基、クリセニル基、ビフェニル基、ターフェニル基などが挙げられる。

また、これら芳香族炭化水素基は以下に示す置換基を有していてもよい。

- (1) ハロゲン原子、トリフルオロメチル基、シアノ基、ニトロ基。
- (2) 炭素数1~25の無置換もしくは置換の、アルキル基、アルコキシ基。
- (3) アリールオキシ基。(アリール基とフェニル基、ナフチル基を有するアリールオキシ基が挙げられる。これらは、炭素数1~25の無置換もしくは置換のアルコキシ基、又はハロゲン原子を置換基として含有してもよい。具体的には、フェノキシ基、1ーナフチルオキシ基、2ーナフチルオキシ基、4ーメチルフェノキシ基、4ーメトキシフェノキシ基、4ークロロフェノキシ基、6ーメチルー2ーナフチルオキシ基等が挙げられる。)
- (4) アルキルチオ基又はアリールチオ基。(アルキルチオ基又はアリールチオ基としては、具体的にはメチルチオ基、エチルチオ基、フェニルチオ基、p-メチルフェニルチオ基等が挙げられる。)
- (5) アルキル置換アミノ基。(具体的には、ジエチルアミノ基、N-メチルー N-フェニルアミノ基、N, N-ジフェニルアミノ基、N, N-ジ(p-トリル) アミノ基、ジベンジルアミノ基、ピペリジノ基、モルホリノ基、ユロリジル基 等が挙げられる。)
- (6) アシル基。(アシル基としては、具体的にはアセチル基、プロピオニル基 、ブチリル基、マロニル基、ベンゾイル基等が挙げられる。)

[0021]

本発明のアリールアミン重合体 (I) ~ (IV) は芳香環上にハロゲン原子、置換もしくは無置換で直鎖または分岐鎖の、アルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基を置換基として有していてもよく、有機溶媒への溶解性向上の観点からは、置換基もしくは無置換で直鎖または分岐鎖の、アルキル基やアルコキシ基、アルキルチオ基が好ましい。これら置換基の炭素数が増加すれば溶解性はより向上するが、その反面、電荷輸送性等の特性は低下してしまうため、溶解性が損なわれない範囲で所望の特性が得られるような置換基を選択することが好ましい。その場合の好適な置換基の例としては炭素数が1~25の、アルキル基、アルコキシ基及びアルキルチオ基が挙げられる。より好適には炭素数が2~18の、アルキル基、アルコキシ基及びアルキルチオ基が挙げられる。これら置換基は同一の

ものを複数導入してもよいし、異なるものを複数導入してもよい。また、これらのアルキル基、アルコキシ基及びアルキルチオ基はさらにハロゲン原子、シアノ基、フェニル基、ヒドロキシル基、カルボキシル基または炭素数1~12の直鎖、分岐鎖もしくは環状のアルキル基やアルコキシ基、アルキルチオ基で置換されたフェニル基を含有していてもよい。

[0022]

アルキル基として具体的には、メチル基、エチル基、nープロピル基、iープロピル基、tーブチル基、sーブチル基、nーブチル基、iーブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、ノニル基、デシル基、3,7ージメチルオクチル基、2ーエチルヘキシル基、トリフルオロメチル基、2ーシアノエチル基、ベンジル基、4ークロロベンジル基、4ーメチルベンジル基、シクロペンチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基等を一例として挙げることができ、アルコキシ基、アルキルチオ基としては上記アルキル基の結合位に酸素原子または硫黄原子を挿入してアルコキシ基、アルキルチオ基としたものが一例として挙げられる。

[0023]

本発明の重合体は、アルキル基やアルコキシ基、アルキルチオ基の存在により、溶媒への溶解性が向上する。これらの材質において溶解性を向上させることは、有機EL素子や有機トランジスタ素子製造の際の、湿式成膜過程の製造許容範囲が大きくなることから重要である。例えば塗工溶媒の選択肢の拡大、溶液調製時の温度範囲の拡大、溶媒の乾燥時の温度及び圧力範囲の拡大となり、これらプロセッシビリティーの高さにより、結果的に高純度で均一性の高い高品質な薄膜が得られる可能性が高くなる。

[0024]

【実施例】

以下に実施例を挙げて本発明を更に具体的に説明するが、本発明はその要旨を 越えない限り、これら実施例によって制限されるものではない。

[0025]

実施例1

重合体1の合成

【化10】

100ml四つロフラスコに、上記のジアルデヒド0.852g(2.70mmol)及びジホスホネート1.525g(2.70mmol)を入れ、窒素置換してテトラヒドロフラン75mlを加えた。この溶液にカリウム t ーブトキシドの1.0mol dm³テトラヒドロフラン溶液6.75ml(6.75mmol)を滴下し室温で2時間撹拌した後、ベンジルホスホン酸ジエチル及びベンズアルデヒドを順次加え、さらに2時間撹拌した。酢酸およそ1mlを加えて反応を終了し、溶液を水洗した。溶媒を減圧留去した後テトラヒドロフラン及びメタノールを用いて再沈澱による精製を行ない、重合体1.07gを得た。収率73%。

元素分析値(計算値); C:84.25%(84.02%)、H:8.20%(7.93%)、N:2.33%(2.45%)。

示差走査熱量測定から求めたガラス転移温度は116.9℃であった。

GPCにより測定したポリスチレン換算の数平均分子量は8500、重量平均分子量は20000であった。

赤外吸収スペクトル(NaClキャスト膜)を図1に示した。

[0026]

実施例2

重合体2の合成

【化11】

実施例1と同様の操作を行ない、上記ジアルデヒド419.5mg (1.00 mmol) 及びジホスホネート564.5mg (1.00 mmol) から重合体 518.3mgを得た。収率62%。

元素分析値(計算値); C:85.18%(85.55%)、H:8.03%(7.63%)、N:2.10%(2.08%)。

示差走査熱量測定から求めたガラス転移温度は133℃であった。

GPCにより測定したポリスチレン換算の数平均分子量は39200、重量平均分子量は116000であった。

赤外吸収スペクトル(NaClキャスト膜)を図2に示した。

[0027]

実施例3

重合体3の合成

【化12】

実施例1と同様の操作を行ない、上記ジアルデヒド1.00g(2.40mm o l)及びジホスホネート1.35g(2.40mm o l)から重合体1.32gを得た。収率82%。

元素分析値(計算値); C:85.33%(85.55%)、H:7.86%(7.63%)、N:2.30%(2.08%)。

示差走査熱量測定から求めたガラス転移温度は151.9℃であった。

GPCにより測定したポリスチレン換算の数平均分子量は44400、重量平均分子量は118000であった。

赤外吸収スペクトル(NaClキャスト膜)を図3に示した。

[0028]

実施例4

重合体4の合成

【化13】

実施例1と同様の操作を行ない、上記ジアルデヒド1.00g(3.32mm o l)及びジホスホネート1.87g(3.32mm o l)から重合体1.32gを得た。収率71%。

元素分析値(計算値); C:83.78%(83.98%)、H:8.02%(7.77%)、N:2.34%(2.51%)。

示差走査熱量測定から求めたガラス転移温度は131.6℃であった。

GPCにより測定したポリスチレン換算の数平均分子量は47900、重量平均分子量は152700であった。

赤外吸収スペクトル (NaClキャスト膜) を図4に示した。

[0029]

実施例5

【化14】

重合体5

200m1四つ口フラスコに、上記のジアルデヒド0.872g(2.648 mmol)及びジホスホネート1.495g(2.648 mmol)を入れ、窒素置換してテトラヒドロフラン80mlおよび、ベンズアルデヒド14.1mg(0.132 mmol)を加えた。この溶液にカリウム t ーブトキシドの1.0 mol dm⁻³テトラヒドロフラン溶液8.00ml(8.00 mmol)を滴下し室温で2時間撹拌した後、ベンジルホスホン酸ジエチル60.5mg(0.265 mmol)を加え、さらに1時間撹拌した。酢酸およそ1mlを加えて反応を終了し、反応溶液を水洗した。溶媒を減圧留去した後テトラヒドロフラン及びメタノールを用いて再沈澱による精製を行ない重合体1.328gを得た。収率86%。

元素分析値(計算値); C:83.80%(84.06%)、H:8.60%(8.90%)、N:2.15%(2.39%)。

示差走査熱量測定から求めたガラス転移温度は122.1℃であった。

GPCにより測定したポリスチレン換算の数平均分子量は13200、重量平均分子量は32500であった。

赤外吸収スペクトル(NaClキャスト膜)を図5に示した。

[0030]

実施例6

重合体6の合成

【化15】

+ (EtO)₂OP
$$\rightarrow$$
 PO(OEt)₂

$$C_6H_{13} \qquad + CH = CH \rightarrow C$$

重合体6

実施例1と同様の操作を行ない、上記ジアルデヒド1.46g(3.80mm o l) 及びジホスホネート1.67g(3.80mm o l) から重合体1.47gを得た。収率75%。

元素分析値(計算値); C:83.94(83.85%)、H:7.21%(7.23%)、N:2.51%(2.72%)。

示差走査熱量測定から求めたガラス転移温度は182.5℃であった。

GPCにより測定したポリスチレン換算の数平均分子量は27900、重量平均分子量は85000であった。

赤外吸収スペクトル (NaClキャスト膜)を図6に示した。

[0031]

実施例7

重合体7の合成

【化16】

実施例 5 と同様の操作を行ない、上記ジアルデヒド 1.00g(2.48 mm o l) 及びジホスホネート 1.40g(2.48 mm o l) から重合体 0.74gを得た。収率 45%。

元素分析値(計算値); C:85.56(85.27%)、H:8.02%(7.78%)、N:2.01%(2.12%)。

GPCにより測定したポリスチレン換算の数平均分子量は22700、重量平均分子量は51900であった。

赤外吸収スペクトル (NaC 1 キャスト膜) を図7に示した。

[0032]

実施例8

重合体8の合成

【化17】

重合体8

実施例5と同様の操作を行ない、上記ジアルデヒド0.872g(2.648 mmol)及びジホスホネート1.495g(2.648 mmol)から重合体1.473gを得た。収率95%。

元素分析値(計算値); C:84.25%(84.06%)、H:8.75%(8.90%)、N:2.23%(2.39%)。

示差走査熱量測定から求めたガラス転移温度は135.8℃であった。

GPCにより測定したポリスチレン換算の数平均分子量は15400、重量平均分子量は39900であった。

赤外吸収スペクトル(NaClキャスト膜)を図8に示した。

[0033]

実施例9

重合体9の合成

【化18】

重合体9

実施例 5 と同様の操作を行ない、上記ジアルデヒド2. 1 2 g (5. 5 0 mm o l) 及びジホスホネート3. 1 1 g (5. 5 mm o l) から重合体3. 3 0 g を得た。収率9 2 %。

元素分析値(計算値); C:84.45%(84.20%)、H:8.82%(8.64%)、N:2.00%(2.18%)。

示差走査熱量測定から求めたガラス転移温度は96.1℃であった。

GPCにより測定したポリスチレン換算の数平均分子量は35600、重量平均分子量は139700であった。

赤外吸収スペクトル(NaClキャスト膜)を図9に示した。

[0034]

実施例10

重合体10の合成

【化19】

重合体 10

300 m l 四つ口フラスコに、上記のジアルデヒド 0.872g(2.65 m m o 1)及びジホスホネート 1.002g(2.65 m m o 1)、ベンズアルデヒド 28.1 m g(0.265 m m o 1)を入れ、窒素置換してテトラヒドロフラン200 m l を加えた。この溶液にカリウム t ーブトキシドの 1.0 m o l d m -3 テトラヒドロフラン溶液 8 m l(8 m m o l)を滴下し室温で 30 分撹拌した後、 1.5 時間還流した。酢酸およそ 1 m l を加えて反応を終了し、反応溶液を水およそ 700 m l 中に滴下し、吸引濾過して重合体 0.83 g を得た。収率 79%。

元素分析値(計算値); C:92.95%(90.19%)、H:6.01%(6.31%)、N:3.62%(3.51%)。

GPCにより測定したポリスチレン換算の数平均分子量は2560、重量平均分子量は4680であった。

赤外吸収スペクトル(NaClキャスト膜)を図10に示した。

[0035]

【発明の効果】

本発明の新規アリールアミン重合体は、優れた発光特性を有すると共に耐久性に優れた有機薄膜EL素子用の高分子材料として、また有機トランジスタ用の電荷輸送性高分子材料として有用である。

【図面の簡単な説明】

【図1】

実施例1で得られた重合体の赤外吸収スペクトル図。

図2

実施例2で得られた重合体の赤外吸収スペクトル図。

【図3】

実施例3で得られた重合体の赤外吸収スペクトル図。

【図4】

実施例4で得られた重合体の赤外吸収スペクトル図。

図5

実施例5で得られた重合体の赤外吸収スペクトル図。

【図6】

実施例6で得られた重合体の赤外吸収スペクトル図。

【図7】

実施例7で得られた重合体の赤外吸収スペクトル図。

【図8】

実施例8で得られた重合体の赤外吸収スペクトル図。

図9]

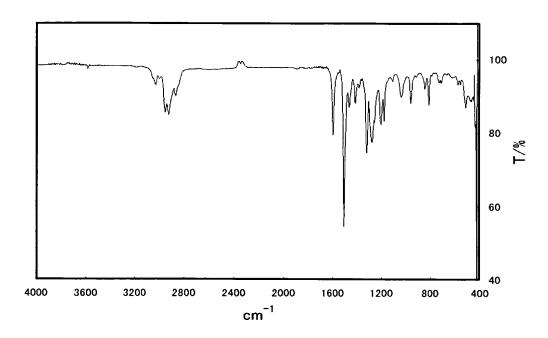
実施例9で得られた重合体の赤外吸収スペクトル図。

図10]

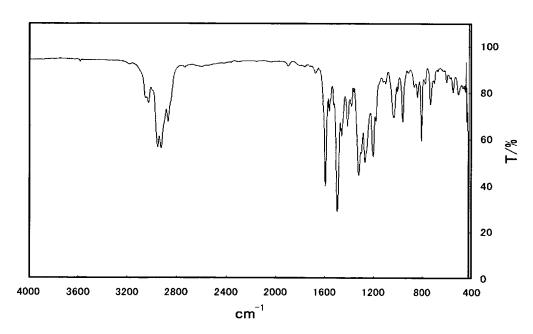
実施例10で得られた重合体の赤外吸収スペクトル図。

【書類名】 図面

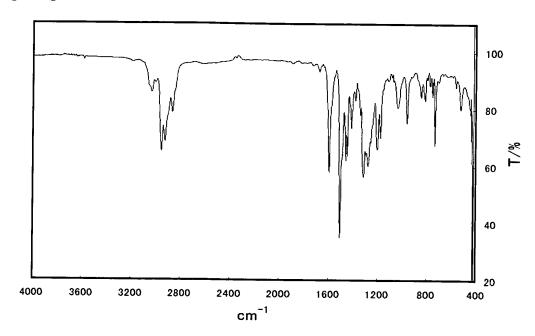
図1]



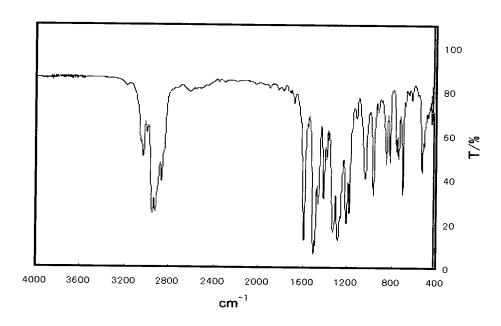
【図2】



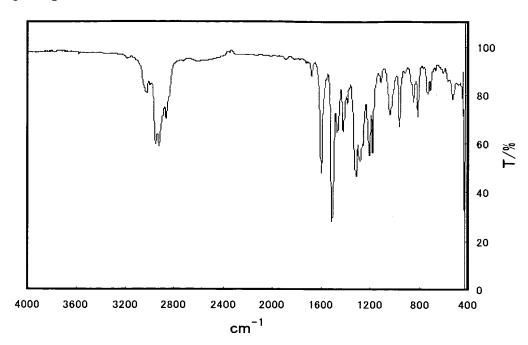
【図3】



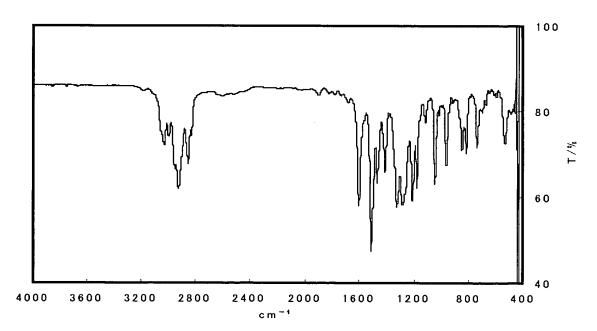
【図4】



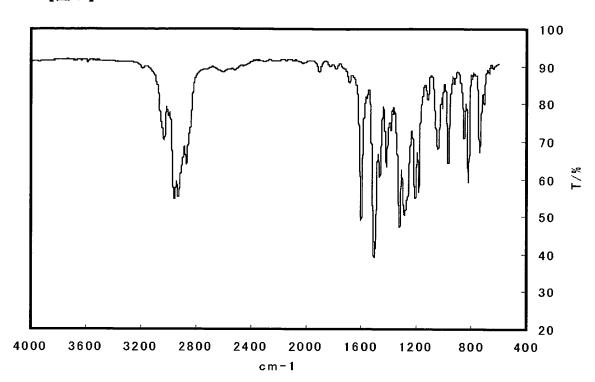
【図5】



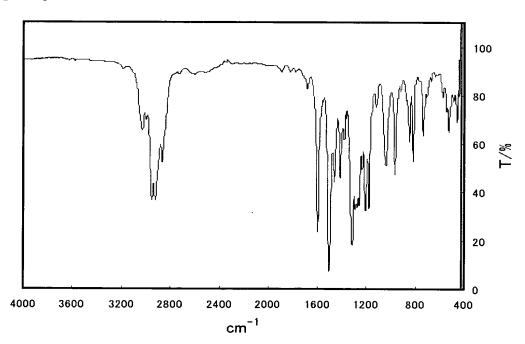
【図6】



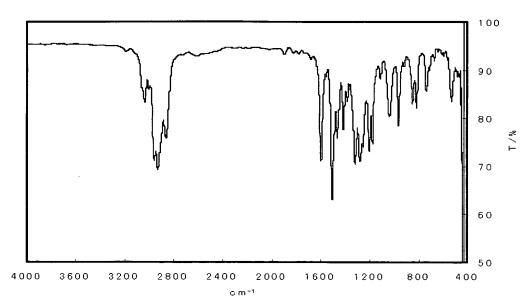
【図7】



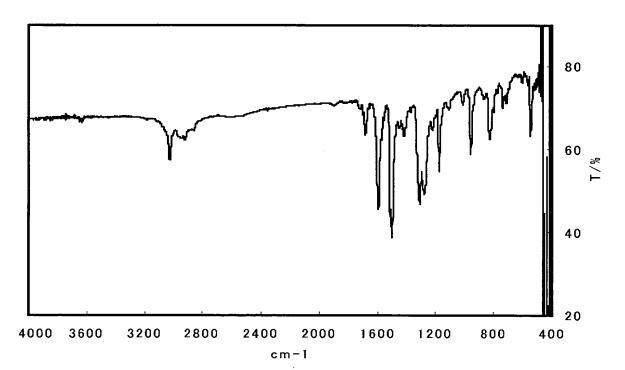
【図8】







【図10】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 発光特性に優れ、かつ耐久性にも優れた、有機EL素子用の高分子材料として、また有機トランジスタ用の電荷輸送性高分子材料として有用な、新規アリールアミン重合体を提供する。

【解決手段】 下記一般式(I)で表される繰り返し単位を含有する重合体。

【化1】

$$\begin{array}{c}
(R^{2})_{y} \\
(R^{3})_{z}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
(R^{3})_{z}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
(R^{1})_{x}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
(R^{1})_{x}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
(R^{2})_{y}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
(R^{3})_{z}
\end{array}$$

(式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 はそれぞれ独立にハロゲン原子、置換もしくは無置換で直鎖または分岐鎖の、アルキル基またはアルコキシ基もしくはアルキルチオ基から選択される基を表し、x、y、zはそれぞれ独立に0から4の整数を表し、 R^1 、 R^2 、 R^3 が各々複数存在する場合には、同一でも別異でもよく、Arは置換もしくは無置換の芳香族炭化水素基を表す。)

【選択図】 なし

特願2003-185402

出願人履歴情報

識別番号

[000006747]

変更年月日
 変更理由]

2002年 5月17日

(理由) 住所変更住所 東京都大

東京都大田区中馬込1丁目3番6号

氏 名 株式会社リコー